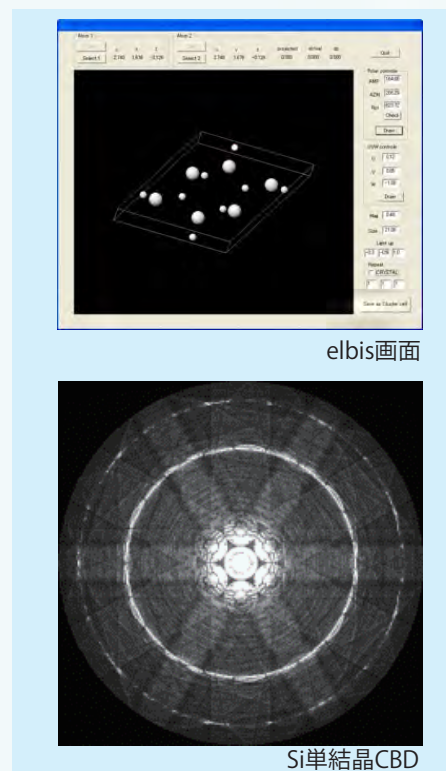


# 電子顕微鏡ステーション・ 微細構造解析プラットフォーム 合同セミナー

GPU 搭載 PC による並列計算を利用することで圧倒的な高速計算処理を実現したリアルタイム TEM/STEM 像収差補正シミュレーションソフトウェア "elbis" に関する紹介とデモ（実演）を実施いたします。ご興味のある方はぜひ参加登録の上、ご参加ください。

※ 参加希望の方は、下記記載の電子顕微鏡ステーションHPよりお申込み下さい。



elbis画面

Si単結晶CBD

日時

2019年 5月 14日 (火)

14:00～16:00 (受付 13:30～)

場所

千現地区 第2会議室  
国立研究開発法人 物質・材料研究機構

入場無料

※5/10 正午前切  
事前登録

- 14:00～15:00 「リアルタイムTEM/STEM像収差補正  
シミュレーションソフトウェア "elbis" の紹介」  
株式会社バイオネット研究所 細川史生
- 15:00～16:00 "elbis" デモ（実演）を含む質疑応答

参加申込用



QRコード

お問い合わせ

NIMS電子顕微鏡ステーション事務局

Email: [tem@nims.go.jp](mailto:tem@nims.go.jp)

Tel: 029-859-2150

[https://www.nims.go.jp/tem/news/20190514\\_001.html](https://www.nims.go.jp/tem/news/20190514_001.html)

▼ インターネットからのお申込み